

2019年度 ナノテクキャリアアップアライアンス  
産総研 MEMS 基本構造製作実習コース（5日間）

■目的、対象者：

先端集積化 MEMS の研究開発を推進している産総研 N-MEMS ファウンドリでの 200mm 径ウェハを使用するマイクロカンチレバー構造の作成を一通り体験することで、フォトリソグラフィ、エッチング等の代表的な MEMS 加工技術や、各種評価技術の基礎を習得する。専門分野によらず MEMS 加工技術に関心がある若手研究者を対象とする。

■募集人数： 各回 4 名程度

■期間：

■会場： 産業技術総合研究所 つくば東 NMEMS 棟

■内容：（都合により内容が変更になる場合があります）

第1日 導入教育1

- ① 導入教育(開講式、講義・見学)
- ② MEMS 概論、プロセス・加工技術の基礎(講義)
- ③ 安全教育(講義)

第2-4日 試作・加工・評価技術の習得

- ④ 1日間 フォトリソグラフィ実習(実習)
- ⑤ 1日間 エッチング、微細加工実習(実習)
- ⑥ 1日間 実装工程、デバイス評価実習(実習)

第5日 まとめと報告書作成

- ⑦ 報告書作成(自習)
- ⑧ 報告会(発表)

■受講料：

学生 50,000 円  
一般 100,000 円

■連絡先： 産業技術総合研究所 TIA 推進センター CUPAL 事務局  
(nanotech-cupal-ml(atmark)aist.go.jp)